

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-215720

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51)IntCl.

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01J 37/22

37/20

C

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全6頁)

(21)出願番号 特願平5-7352

(22)出願日 平成5年(1993)1月20日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(71)出願人 000233240

日立計測エンジニアリング株式会社

茨城県勝田市堀口字長久保832番地2

(72)発明者 四辻 貴文

茨城県勝田市堀口字長久保832番地2 日

立計測エンジニアリング株式会社内

(72)発明者 小林 弘幸

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立

製作所計測器事業部内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54)【発明の名称】 電子顕微鏡

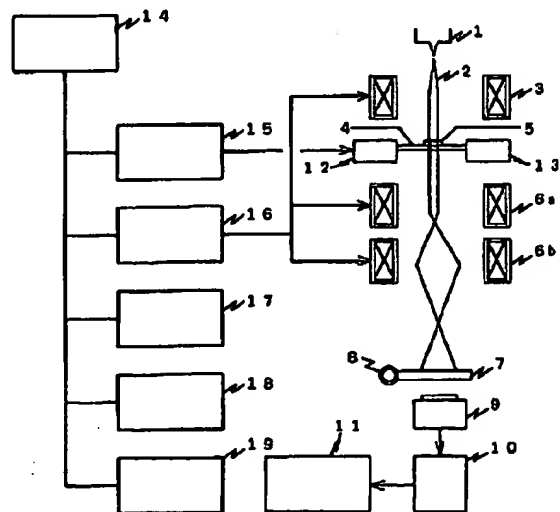
(57)【要約】

【目的】電子顕微鏡において従来手作業で行っていた試料の検索を、CPUを用いて試料台の移動を自動化し、試料の検索効率の高い電子顕微鏡を提供することにある。

【構成】試料5を装着した試料台4を透過電子線像の倍率に連動した移動量で、X軸、Y軸の2方向に自動的に移動させる。試料台4の移動範囲、移動速度、加減速時間等の駆動の条件を、条件表示CRT19に表示し、操作部18で駆動の条件を設定することで、指定範囲内の試料5の検索を行えるように構成する。

【効果】従来手作業で行っていた試料の検索を自動化することで、短時間で効率良く試料の検索が可能となり、電子顕微鏡の操作性が飛躍的に向上する。

図1



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-215720
 (43)Date of publication of application : 05.08.1994

(51)Int.Cl.

H01J 37/22
 H01J 37/20

(21)Application number : 05-007352

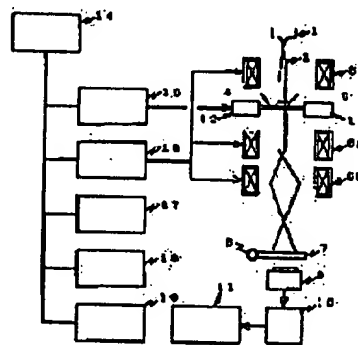
(71)Applicant : HITACHI LTD
 HITACHI INSTR ENG CO LTD
 (72)Inventor : YOTSUTSUJI TAKAFUMI
 KOBAYASHI HIROYUKI

(54) ELECTRON MICROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an electron microscope having high detection efficiency for a sample by achieving the retrieval of samples, which is conventionally carried out manually, in an electron microscope by automating the movement of a sample board by using a CPU.

CONSTITUTION: A sample board 4, in which a sample 5 is fitted, is automatically moved in the two direction of axes X and Y by the amount of movement interlocking with the magnification of a transmission electron beam image. Operational conditions such as the range of movement, the velocity of movement, and acceleration/deceleration time are displayed on a condition display CRT 19, and the retrieval of a sample 5 in a designated range is carried out by setting the operational conditions by an operation part 18. Effective retrieval of samples can be achieved in a short period of time by automating the retrieval of samples which is conventionally carried out manually, and the operability of the electron microscope is drastically improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number]
 [Date of registration]
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office